中国激光

第14卷 第5期

SF₆-UF₆-H₂体系激光光敏反应中红外荧光的研究

何志强 侯惠奇 秦启宗

(复旦大学激光化学研究室)

提要:研究了由 10.6 μ m P(24)支线脉冲 CO₂激光 引发 SF₆-UF₆-H₂体系 红 外光敏反应中产生的红外荧光。当体系的红成和激光频率都不变时,由 HF*产生的 荧光信号强度与激光的能量密度呈线性关系,改变体系中 UF₆的分压,红外荧光信 号的强度和时间特性都发生比较明显的变化。此外,由 SF₆-UF₆-H₂体系红外光敏 反应的动力学讨论了上述红外荧光的一些特性。

Infrared fluorescence from laser induced sensitized reaction of SF₆-UF₆-H₂ system

He Zhiqiang, Hou Huiqi, Qin Qizong (Laser Chemistry Laboraotry, Fudan University, Shanghai)

Abstract: Infrared fluorescence from the sensitized reaction in $SF_6-UF_6-H_2$ system induced by 10.6 μ m P(24) line of a pulsed CO₂ laser is investigated. The time resolved IR fluorescence of vibrationally excited HF* is measured with an InSb photovoltic detector and is compared with that from the SF_6-H_2 system under the similar experimental conditions. Our results show a linear dependence of fluorescence intensity with laser fluence. The time resolved IR fluorescence of HF* is dependent on the partial pressure of UF₆, the fluorescence intensity obey the single exponential decay at lower P_{UF_6} , but non-single exponential decay is observed at higher P_{UF_6} . The time dependence of the HF* fluorescence intensity is explained with the infrared photo-sensitized reaction mechanism of the $SF_6-UF_6-H_2$ system.

关于六氟化铀的红外激光化学研究已有 不少报道,由 TEA CO₂激光诱导的六氟化 铀红外光敏反应日益受到重视^[1,2]。Angelie 等^[3]在研究 SF₆-SF₅Cl和 SF₆-CF₃I体系的 红外激光光敏反应时,曾分别获得硫同位素 和碳同位素的富集效应。这些都难以由红外 光敏反应中单纯的加热效应来解释。我们曾 采用 H₂和 CO 作为 F 原子的清除剂,并认 为该反应具有非热反应的机理^[4~7]。前人有 关UF6 红外光敏反应的研究主要是利用红 外光谱分析最终产物,而未能获得该反应的 动力学过程中的有关中间产物的一些信息。

本文着重测量了 SF₆-UF₆-H₂ 体系在红 外光敏反应中所产生的中间产物。振动受激 的 HF* 红外荧光的时间特性,通过研究激光

收稿日期: 1986年2月19日。

· 279 ·

能量密度和 UF。分压对时间分辨的 红外 荧 光的影响,进一步探讨该红外光敏反应的机 理。

实 验

本实验所用的装置如图 1 所示,用于激 发 SF₆ 的 TEA CO₂ 激光器主脉冲的峰宽为 150 ns,占脉冲总能量的 70% 左右,还有较 长的拖尾(~1 μ s);所用的 10.6 μ m P(24)支 线 CO₂ 激光是由红外平面光栅(100 条/mm) 选频。激光频率用 CO₂ 激光支线分析 仪 监 测;激光能量用 RJ-P-735 和 736 型热电探 头和 R₂-7200 型激光能量计直接读出。



图 1 测量 HF* 红外荧光的实验装置示意图 1-TEACO₂ 激光器; 2-样品池; 3-滤光片; 4-InSb 探测器; 5, 6-激光能量探头; 7-能 量计; 8-光子牵引探测器; 9-示波器

由不锈钢制成的样品池内呈十字状,各 窗口的内径为 34 mm,以 KOI 单晶作窗片, 用 Viton"0"圈和法兰盘固定。样品池充气 后,入射激光束平行进入池内,测量红外荧光 的 InSb 探测器置于入射激光束的垂直方向。 为消除杂散光的影响,在红外探测器前放置 一中心透过波长为 2.90 μm 的红外干涉滤 光片。由此测得的 HF*荧光信号经放大器 后,直接由 SR13A 型(300 MHz)示波器读出 和照相记录。红外荧光信号由光子牵引探测 器获得的激光脉冲信号触发。为了避免各种 干扰, InSb 探测器用液氮冷却(77 K),实验 测量装置放在接地良好的法拉第屏 蔽 室内。 由此获得的荧光信号的信噪比较高,不必考 虑再用信号平均器等。

纯化和转移 UF₆ 等气体的真空系统用 不锈钢和紫铜制成,真空度可达 10⁻⁴ Torr。 为了防止氟和 UF₆ 腐蚀的影响,该真空系统 和样品池在使用前需经氟气纯化 4 天。样品 池内充入各气体的压力由 YG 型光标微压力 计读出。

UF₆、SF₆和 H₂在使用前的纯化方法 见[6]。

结果和讨论

1. SF₆-H₂体系与 SF₆-UF₆-H₂体系 红外荧光特性的比较。

首先用 SbIn 探测器 测量 SF₆-H₂体系 在较低压力下在 2.9 μ m 处 HF*的红外荧 光。将 10.6 μ m P(24)支线的脉冲 CO₂激光 经聚焦后辐照 0.2 Torr SF₆+2.0 Torr H₂的 混合气体,在激光能量 密度为 300 mJ/cm² 时,测得 SF₆ 解离所产生的 HF*的红外荧光 信号的上升时间为 2.6 μ s,由此求 算得 F+ H₂—→HF*+H 反应的速率常数为 9.6× 10⁵ s⁻¹ Torr⁻¹,与文献[8]的结果是一致的。 当增加样品池中 SF₆的分压至 2.0 Torr 时, 在上述相同的实验条件下测得 HF*的荧光 信号如图 2 所示。由图见,在激光脉冲触发 后红外荧光信号的出现约有 3±0.5 μ s 的时 间延迟,这也与 Preses 等^{[69}测得的结果相近。



对于 2.0 Torr SF₆ + 0.6 Torr UF₆ + 2.0 Torr H₂ 体系, 在与上述相似的实验条件下, 测得 UF₆ 解离而产生的 HF^{*} 的荧光信

. 280 .

号如图3所示。将它与图2的红外荧光信号 比较,发现两者在荧光的时间特性上有比较 明显的差别: (1) SF6-UF6-H2体系荧光信 号的延迟时间为5±0.5 µs, 明显地比SF6-H₂体系约长2µs。这可能是因前者需经 SF₆-UF₆分子间的多次碰撞和V-V能量转 移,才能使 UF6 解离而产生 HF* 的红外 荧 光。我们曾测定过 SF₆-UF₆ 分子间 V-V 能 量弛豫时间为 µs 级^[10], 与上述的荧光信号 延迟时间相近。(2)在SF6-田2体系中由SF6 解离而产生的红外荧光衰减很快,约为 100/:s; 而在 SF₆-UF₆-H₂ 体系中 UF₆ 解离 产生的红外荧光的衰减比较缓慢,约在 200 µs 以上。这可能是由于 UF6 光敏反应中 产生 HF* 的途径比较复杂。 除由 UF6 直接 解离的 F 原子与 H2 反应产生的 HF* 之外, 还有一些次级反应也将生成 HF*, 特别是在 UF6分压较大时,这些影响将更为明显。



(激光辐照条件同图 2)

系

2. 红外荧光强度与激光能量密度的关

以脉冲 CO₂ 激光 辐照 2.0 Torr + 1.0 Torr UF₆+2.0 Torr H₂ 混合气体,测得红外 荧光强度(I_f)与激光能量密度(E_J)之间的 关系,见图 4。在 200~400 mJ/cm²范围内 $I_f \sim E_J$ 呈良好的线性关系。此结果与前人^[6] 对 SF₆-H₂体系测得的 $I_f - E_J$ 的关系相似。 值得指出的是,在 SF₆-UF₆-H₂体系的光敏 反应研究中,我们曾测得 UF₆ 的解离率与 E_J 也呈线性关系^[4]。

按前文^[5]提出的 UF₆ 红外光 敏 反 应 的 机理, HF^{*} 的产生和猝灭主要由下列各步所



图 4 红外荧光强度与激光能量密度的关系 (激光频率 938.7 cm⁻¹)

组成:

或

$$SF_6 \xrightarrow{k_1} SF_6^*$$
(1)

 $SF_6^* + UF_6 \xrightarrow{k_2} SF_6 + UF_6^*$ (2)

$$\mathrm{UF}_{6}^{*} \xrightarrow{\kappa_{3}} \mathrm{UF}_{5} + \mathrm{F} \qquad (3)$$

$$F + H_2 \xrightarrow{\kappa_4} HF^* + H$$
 (4)

 $\mathrm{HF}^* + \mathrm{Mi} \xrightarrow{k_{54}} \mathrm{HF} + \mathrm{Mi} \tag{5}$

上式中 Mi 是指 SF₆、UF₆ 或 H₂,在激光能 量密度不高时,并且体系中含有 UF₆ 的情况 下,由 SF₆ 多光子解离而产生 F 原子 的可能 性很小。因此,可以认为 SF₆–UF₆–H₂ 体系 产生的红外荧光强度(I_t)正比于反应(4)生 成的 HF* 浓度,它随时间变化的关系式可由 反应(4)和(5)的动力学方程推导而得:

 $I_{f} = c [HF^{*}]$ $= \frac{ck_{4}[H_{2}][F]}{k_{4}[H_{2}] - \sum_{i} k_{5i}[M]_{i}}$ $\times \{e^{-\sum_{i} k_{i}(Mi]t} - e^{-k_{4}(H_{3})t}\} \qquad (6)$ $I_{f} = I_{0}(e^{-t/\lambda_{D}} - e^{-t/\lambda_{3}}) \qquad (7)$

式中 c 是比例常数, I_0 是由荧光衰减曲线外 推至 $t \rightarrow 0$ 时的荧光强度; $\lambda_D = 1/\sum_i k_{5i}$ [Mi], 即荧光衰减时间常数; $\lambda_R = 1/k_4$ [H₂], 即荧 光上升时间常数。

由于受激 SF₆ 与 UF₆ 分子间 V-V 能量 转移速率很快,同时应考虑 UF₆ 分子的碰撞 去活化过程,即

 $UF_6^*+Mi \xrightarrow{k_{64}} UF_6+Mi$ (8) 这样由式(2), (3)和(8)可写出 UF₆*的速率 方程:

 $\frac{d[\mathrm{UF}_6^*]}{dt} = k_2[\mathrm{UF}_6][\mathrm{SF}_6^*]$

 $-k_3[\mathrm{UF}_6^*] - \sum k_{6i}[\mathrm{UF}_6^*][\mathrm{Mi}]$

由稳态近似法得

 $[\mathbf{UF}_{6}^{*}] = k_{2}[\mathbf{UF}_{6}][\mathbf{SF}_{6}^{*}]/\{k_{3} + \sum_{i} k_{6i}[\mathbf{M}_{i}]\}$ (9)

上式中 SF。6 的浓度按 (1) 式可以认为是与脉 冲 CO₂ 激光的能量密度 *E*_J 成正比的。因在 式(6)中的 F 原子浓度 [F] 是由 UF。直接解 离而得,则由式(6)和(9)得红外光敏反应中 的荧光强度

$$I_{f} = \frac{c' \cdot E_{J} \cdot k_{2} \cdot k_{4} [\operatorname{H}_{2}] [\operatorname{UF}_{6}]}{\{k_{4} [\operatorname{H}_{2}] - \sum_{i} k_{5i} [\operatorname{Mi}]\} \{k_{3} + \sum_{i} k_{6i} [\operatorname{Mi}]\}} \times (e^{-t/\lambda_{D}!} - e^{-t/\lambda_{a}})$$
(10)

由上式可知,在反应体系各组份的浓度 变化不大的情况下,红外荧光强度与激光能 量密度 *E*₁ 成正比。这正好与图4所示的实 验结果是一致的。

三、红外荧光信号与 UF₆ 分压的关系

在 SF₆ 和 H₂ 分压各为 2.0 Torr 时,改 变 UF₆ 分压,经 300 mJ/cm² 脉冲 CO₂ 激光 辐照而得的 HF^{*} 红外荧光信号见图 5。

由图 5 可以看出,对不同的 UF₆ 分压测 得的红外荧光信号有较明显的差别。在 p_{UF} <0.6 Torr 时,荧光衰减基本上符合式(7) 所示的 $I_{f} \sim t$ 的单指数衰减。但在 $p_{\text{UF}} \geq$ 1.0 Torr 以后,不仅荧光衰减偏离了单指数 衰减曲线,而且荧光强度随时间的变化出现 了一些起伏,衰减也比较缓慢。这些结果与 陆庆正等^[11] 对 SF₆-D₂ 体系的红外激光诱导 反应在 SF₆ 分压较高时测得 DF* 的荧光 信



号十分相似。

在 UF。分压较高时的红外荧光时间特性,可以由激光光敏反应中可能出现其他的 次级反应来解释。因为产生红外荧光的 HF[•], 反应(4)产生的活泼 H 原子也可能与 UF。反 应而生成 HF^{*},即

 $H+UF_6 \longrightarrow HF^*+UF_5$ 。 (11) 在 p_{UF} ,较高时,则上述反应(11)对红外荧光 的贡献逐渐明显,于是产生了如图 5(c)、(d) 所示的结果。

在不同的 UF₆ 分压下 HF^{*} 的荧光强度 $I_0 = p_{UF_4}$ 关系见图 6。可以看出在 $p_{UF_4} \leq 1.0$ Torr 时, I_0 随 p_{UF_4} 增加而增大, 但在 $p_{UF_4} > 1.0$ Torr 以后的 I_0 却明显地减小。这



表1 脉冲宽度计算结果

	1#	脉冲	2# 脉冲			
观测次数	T(ns)	$\tau(ns)$	H	T(ns)	$\tau(ns)$	H
1	0.24	0.28	0.0011	0.39	0.46	0.0027
2	0.25	0.29	0.0051	0.34	0.40	0.0022
3	0.24	0.28	0.0024	0.39	0.46	0.0032
	τ	=0.281	ns	$\overline{\tau} = 0.44 \mathrm{ns}$		

了运转在第一种情况时氩离子锁模激光的纵 模,观测结果如图3所示。由关系式



图 3 1 # 脉冲激光纵模照片

可估算出 1[#] 脉冲宽度为 260 ps。式中 τ—— 脉宽, N——纵模数; L——激光腔长; c—— 光速。同样观测运转在第二种状态时的锁模 激光脉冲宽度为 430 ps。用解卷积法求得的 结果与该观测结果很好吻合。

讨 论

1. 测量信号的信噪比直接影响结果的

(上接第282页) 可能与反应体系在吸收激光能量后SF₆和

UF₆分子间能量的分布不同有关。

参考文献

- [1] Karve R. S. et al.; Chem. Phys. Lett., 1981, 7, 273.
- [2] C. Angelie et al., Chem. Phys., 1982, 66, 129.
- [3] M. Cauchetier et al.; Chem. Phys. Lett., 1982, 88, 146.

准确性。当信号噪声高到一定程度时,会便 卷积运算失效,故在测量中要使信号噪声减 小到最小。噪声主要来源于周围环境的干扰 及输入电缆失配。

 在观测时,应使提取仪器响应函数的 脉冲强度与待测脉冲强度近似相等。这样在 两次观测中测试仪器的工作状态完全一致, 避免仪器在不同状态下所带来的影响,减小 测量误差。

3. 此法中提取测量系统仪器响应函数
是用一个窄脉冲来实现的,也就是说,该窄脉冲相对待测脉冲可视为一δ函数,即

$$F(t) = \int \delta(t') F(t-t') dt' \qquad (8)$$

因此提取仪器函数所用的窄脉冲要足够窄。 这个脉冲的宽度越宽,所得到的结果偏离真 实值越大。本工作所用的窄脉冲宽度是待测 脉宽的 2% 左右。从图 2 中看出该测量系统 的时间响应半宽度为 440 ps。

4. 该方法可用来测量连续脉冲序列的 脉宽,亦可用来测量脉冲式锁模脉冲的宽度。

参考文献

1]	М.	Maier	et a	ι;	Phys.	Rev.	Lett.,	1966,17,	1275.
----	----	-------	------	----	-------	------	--------	----------	-------

- [2] G. R. Fleming, G. S. Beadar; Opt. and Laser
- Technologe, 1978, 10, No. 5, 257.
- [3] 陈文驹,林美荣,姜宏丽;《光学学报》,1985,5, No. 10,904.
- [4] 陈文驹,林美荣,姜宏丽;《光学学报》,1986,6,1124.
- [5] A. W. Smith, A. J. Landon; Appl. Phys. Lett., 1970, 17, No. 8, 340.
- [4] 秦启宗等; 《核科学与工程》, 1983, 3, 239.
- [5] China, C. -T. et al.; Chem. Phys. Lett., 1983, 101, 69.
- [6] 侯惠奇等; 《化学学报》, 1984, 43, 24.
- [7] 侯惠奇等; 《科学通报》, 1984, 29, 853.
- [8] C. R. Quick, Jr; Wittig Curt; Chem. Phys. Lett., 1977, 48, 420.
- [9] J. M. Preses, R. E. Weston, Jr.; Chem. Phys. Lett., 1977, 48, 425.
- [10] 蔡中厚等;《物理化学学报》,待发表。
- [11] 陆庆正等; 《中国科学技术大学学报》, 1984, 14, 365.